ガラス上における非晶質 GaAs 薄膜の固相成長 Solid-Phase Crystallization of Amorphous GaAs Thin Film on Glass 筑波大院 ^o斎藤聖也,西田竹志,茂藤健太,末益崇,都甲薫

Univ. of Tsukuba, °Masaya Saito, Takeshi Nishida, Kenta Moto, Takashi Suemasu, and Kaoru Toko

E-mail: saimasa.tkb@gmail.com

【はじめに】III-V族化合物半導体(GaAs等)は太陽電池や発光素子に用いられているほか、次世 代の高キャリア移動度材料としても期待されている。しかし、基板コストの高さから応用が限ら れる。そこで、Si酸化膜やガラス等の絶縁体上にGaAs薄膜を合成する研究が行われてきた。しか し、これまで得られてきた多結晶GaAs薄膜は、非常に小粒径であり、特性は劣悪であった。最近我々は Geの固相成長において、前駆体となる非晶質膜を高密度に堆積することで、多結晶Geが劇的に大粒 径化する現象を発見し、最高のキャリア移動度(正孔: 620 cm²/Vs、電子: 340 cm²/Vs)を実現した[1,2]。 今回、本手法をGaAsに応用し、GaAs薄膜の大粒径化に向けた非晶質薄膜の堆積条件を検討した。

【実験方法】分子線堆積法を用いて、石英ガラス基板上に、Ga と As を同時堆積した。この時、Ga ク ヌーセンセル(K セル)温度を925 ℃ に固定し、As K セル温度 T_{As}を 220 ℃ から 235 ℃ の範囲で変調 することで、GaAs の組成比を制御した。GaAs の組成比は、EDX 測定により同定した。その後、N₂ 雰囲 気中で熱処理(400 ℃, 25 h)を施し、固相成長を誘起した。ラマン分光法により、固相成長前後の試料の 結晶性を評価した。また、EBSD 法により、固相成長後の試料の結晶粒径と配向性を評価した。

【結果・考察】 Fig. 1(a)より、 T_{As} によって GaAs の組成比を制御可能であり、 $T_{As} = 230$ °C において、化学 量論組成(Ga/As = 1)に近い値(0.98)が得られた。Fig. 1(b)より、Ga/As = 0.78 および Ga/As = 0.98 の試 料では、非晶質 GaAs に起因するブロードなピーク(255 cm⁻¹付近)が観測された。一方、Ga/As = 1.19 お よび Ga/As = 2.01 の試料では、非晶質 GaAs のピークに加えて、結晶 GaAs の TO フォノンに起因するピ ーク(270 cm⁻¹付近)とLO フォノンに起因するピーク(290 cm⁻¹付近)も観測された。すなわち、Ga リッチの 試料では、堆積時に GaAs が一部結晶化することが判る。Fig. 2(a)より、全ての熱処理後の試料において 結晶 GaAs に起因するピークが観測され、GaAs の結晶化が確認された。また、Ga/As = 0.78 の試料では、 As クラスターに起因するピーク(200 cm⁻¹付近および 255 cm⁻¹付近)が観測され、過剰な As の析出が示 唆される。Fig. 2(b)-(e)より、Ga/As=0.98 の試料において粒径約 0.2 µm の(111)配向粒が観察された一 方、その他の試料では粒径は EBSD の分解能以下であった。以上の結果は、前駆体の組成が固相成長 GaAs の結晶性に顕著な影響を与えることを示唆している。現在、組成を制御した上で、前駆体の加熱堆 積(膜密度)が固相成長 GaAs の結晶性に与える影響について検討中である。



[1] T. Imajo et al., Appl. Phys. Express 12, 015508 (2019).

[2] M. Saito *et al.*, Sci. Rep. **9**, 16558 (2019).



Fig. 1. Crystallinity of as-deposited GaAs.

(a) T_{As} dependence of Ga/As. (b) Raman spectra for each Ga/As.

Fig. 2. Crystallinity of GaAs after annealing at 400 $^{\circ}$ C. (a) Raman spectra for each Ga/As. (b)-(e) IPF images for each Ga/As.